

СОДЕРЖАНИЕ

Том 65, номер 9, 2001

Материалы XVIII Российской конференции по электронной микроскопии

Н. И. Боргардт, Б. Пликат, М. Зайбт, В. Шретер	
Метод моделирования усредненных высокоразрешающих изображений кристаллически-аморфных интерфейсов	1238
Т. А. Гришина, Б. Н. Васичев	
Применение дифракционного интеграла Кирхгофа для описания дифракции электронов на кристаллической решетке при исследовании твердых тел	1247
Л. Б. Розенфельд, Б. Н. Васичев, М. О. Зотова	
Численное моделирование влияния дефектов изготовления на аберрационные характеристики магнитных квадрупольных линз и стигматоров	1253
Б. Н. Васичев, Е. П. Михальцов, Л. Б. Розенфельд	
Иммерсионный объектив изображающей системы фото- и эзоэмиссионных электронных микроскопов	1257
К. С. Максимов, С. К. Максимов	
Закономерности электронно-микроскопических изображений с дилатационным и интерференционным контрастом и адекватность моделей неравновесного упорядочения в композициях $A^{III}B^V$	1260
Е. В. Ракова, Н. Д. Степина, В. В. Клечковская, Т. В. Панова, И. И. Самойленко, О. М. Жигалина, Л. А. Фейгин	
Структурное исследование нанокристаллов CdS, выращенных под ленгмюровским монослоем бегената кадмия	1268
О. М. Жигалина, П. В. Бурмистрова, А. Л. Васильев, В. В. Роддатис, К. А. Воротилов	
Микроструктура многослойных композиций Si/SiO ₂ /Ti/Pt/PZT	1272
Л. С. Коханчик, К. А. Воротилов, А. С. Сигов	
РЭМ-исследование сегнетоэлектрических пленок цирконата-титаната свинца, полученных методом химического осаждения из растворов	1276
Н. Д. Степина, В. В. Клечковская, Л. Г. Янусова, Л. А. Фейгин	
О структурной организации пептидных ленгмюровских монослоев и пленок Ленгмюра-Блоджетт	1280
Л. С. Коханчик, К. А. Воротилов, А. С. Сигов, М. И. Яновская	
Условия кристаллизации и свойства пленок титаната бария – стронция, формируемых методом химического осаждения из растворов	1283
В. П. Власов, В. М. Каневский	
Электронная спектроскопия и электронография переходных слоев, образующихся при epitаксии Au, Ag, Cu на KCl(100)	1288
Б. Н. Зайцев, А. В. Душкин, В. В. Болдырев	
Криофрактографическое изучение структурных превращений при механохимической реакции нейтрализации органических кислот	1292
А. В. Гостев, А. Кхуршид, М. Остерберг, Э. И. Рэй, Р. А. Сеннов	
Анализ экспериментальных и расчетных характеристик электростатического торoidalного спектрометра отраженных электронов в РЭМ	1295

Э. И. Рай, А. В. Гостев, Чжу Шичу	
Определение диффузионной длины и скорости поверхностной рекомбинации неравновесных носителей заряда в полупроводниках методами наведенного тока и электронно-индукционного потенциала	1300
К. М. Девяткова, Л. И. Девяткова, В. Б. Тверской, Т. В. Красюк	
Исследование в РЭМ диссипативных и волновых структур во фторидных монокристаллах $\text{BaF}_2 \cdot 2\text{YF}_3$: Er, Yb	1304
Ю. Е. Гагарин, В. И. Петров, М. А. Степович	
Оценка возможностей конфлюентного анализа для измерений диффузионных длин неосновных носителей заряда катодолюминесцентным методом	1308
М. Д. Бельский, А. В. Суворинов, Т. С. Филиппчук	
Применение теории оптимального управления к оптимизационным задачам зондоформирующей электронной оптики	1312
Г. Г. Лепешов, А. К. Кулыгин, А. С. Авилов, С. М. Шкорняков	
Электронная дифрактометрия и количественный анализ электростатического потенциала в ионных кристаллах	1316
В. Н. Самойлов, К. В. Дехтяр	
О некоторых новых особенностях распыления грани (111)Ni с одновременным угловым и энергетическим разрешением	1324
Э. И. Рай, Р. А. Сеннов, Л. Реймер, Х. Хоффмайстер	
Оценки локальных толщин пленок в многослойных структурах по спектрам отраженных электронов в РЭМ	1328
Б. Н. Васичев	
Радиационная модификация материалов при их исследовании в сверхвысоковольтном электронном микроскопе	1332
Т. А. Гришина	
Просвечающая электронная микроскопия как источник информации о свойствах электрона	1335
Б. Н. Васичев	
Анализ распределения продольных пространственных частот в многоэлементных электронно-оптических системах	1338
Б. Н. Васичев	
Электронная оптика электронного микроскопа как вычислительная среда	1345
Ю. Я. Томашпольский	
Вопросы количественной вторично-электронной эмиссионной микроскопии поверхности	1349
О. Д. Потапкин, Б. Н. Васичев	
Перспективы развития комбинированного фотоэмиссионного низковольтного отражательного электронного микроскопа	1359
О. Д. Потапкин, А. С. Беланов	
Электронные пушки для электронной микроскопии	1363
А. С. Авилов	
Прецизионная электронография – метод изучения связи атомной структуры с физическими свойствами кристаллов	1367